日本真空学会 2015年6月研究例会

主題「低真空・中真空計測の最新動向」

低真空・中真空領域(100 kPa~0.1 Pa)の真空技術は、各種CVDやプラズマ処理を利用した半導体産業を始め、自動車、化学・医薬品、電機・電子、製紙・印刷、食品、機械など、幅広い産業分野において、成形、注入、含浸、脱水、濃縮、乾燥、吸着搬送、包装など幅広い用途に利用されています。低真空・中真空の計測技術は、これら分野の研究開発や、生産現場における品質管理を行う上で、重要な役割を担っております。低真空・中真空を計測する真空計には、弾性真空計(隔膜真空計など)、熱伝導真空計(ピラニ真空計など)、粘性真空計(スピニングロータ真空計やクリスタル真空計)などがあり、それぞれの特徴を良く理解して、真空計を選定し、利用することが重要です。

そこで今回は、低真空・中真空計測の基本原則を振り返るとともに、隔膜真空計、熱伝導真空計、粘性真空計を開発・製造しているメーカー各社から、新技術した利用した各種真空計や計測技術について、ご講演頂きます。本研究会が、低真空・中真空計測における、現在の課題や近未来に求められる技術について議論する機会となることを願っております。

日 時：2015年6月9日(火) 11:00~18:50(受付10:30~)

会 場：機械振興会館 地下2階 B2-1 号室

東京都港区芝公園 3-5-8 <http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/access.html>

TEL 03-3431-4395 (日本真空学会)

協 賛：日本真空工業会

講演プログラム

開会の挨拶	イントロダクトリートーク	(産業技術総合研究所) 吉田 肇	11:00~11:05
1.	低真空・中真空計測の原理	(産業技術総合研究所) 平田正紘	11:05~11:45
	(休憩)		
2.	The latest performance of low pressure sensors, direct and indirect gauges	(日本エム・ケー・エス㈱) 未定	12:50~13:15
3.	The latest innovations in industrial vacuum measurement	(インフィコン㈱) Carsten Strietzel	13:15~13:40
4.	M-342DG キャパシタンスゲージ	(キヤノンアネルバ㈱) 宮下治三	13:40~14:05
5.	サファイア隔膜真空計の開発と製品の特長	(アズビル㈱) 吉川康秀	14:05~14:30
6.	隔膜式絶対圧センサの現状と次世代センサ	(㈱テムテック研究所) 相澤満芳	14:30~14:55
	(休憩)		
7.	ピエゾ型隔膜真空計の特長	(大亜真空㈱) 高宮祐二	15:10~15:35
8.	クリスタルゲージ/CCゲージ複合 ワイドレンジ真空計の特性	(東京電子㈱) 黒岩雅英, (VISTA㈱) 大迫信治	15:35~16:00
9.	マイクロハクマク圧力センサを用いたチャンバ内圧力分布計測の実例	(㈱岡野製作所) 田尻修一	16:00~16:25
10.	真空計測における JCSS への取り組み……「誤差」から「トレサビリティ」と「不確かさ」へ	(㈱アルバック) 吉澤秀樹	16:25~16:50
挨拶	(日本真空学会 講演・研究会企画委員会委員長) 中村 健		16:50~16:55
技術交流会(ポスターセッション)			17:00~18:50

参加費 (事前に ofc-vsji@vacuum-jp.org 宛にお申し込みの上、当日会場にてお支払いください)

日本真空学会会員, 協賛学協会会員 2,500円 (予稿集代を含む)

非会員 3,500円 (予稿集代を含む)

学 生 無 料 (予稿集500円)

申し込み・問い合わせ先

一般社団法人 日本真空学会 TEL 03-3431-4395 FAX 03-3433-5371

e-mail: ofc-vsji@vacuum-jp.org URL <http://www.vacuum-jp.org>

本件担当

一般社団法人 日本真空学会 講演・研究会企画委員会

(産業技術総合研究所) 吉田 肇, (キヤノンアネルバ㈱) 中村 恵